中国海光

第11卷 第9期

GaAs-Al_{0.3}Ga_{0.7}AsDH 共腔 双二极管激光器

黄 熙 赵礼庆

(中国科学院半导体研究所)

提要:本文报道了 GaAs-Alo.3Gao.7As DH 共腔双二极管激光器的 实验制备。 对这种激光器的稳态输出特性和瞬态输出特性作了实验观测。

A GaAs-Alo.3Gao.7As DH laser with two-sections in a common cavity

Huang Xi, Zhao Liqing

(Institute of Semiconductors, Academia Sinica)

Abstract: In this paper, the experimental fabrication of a GaAs-Al_{0.3}Ga_{0.7}As DH laser with two-sections in a common cavity is reported. The stable output and transient output characteristics of the laser were measured.

一、引言

近年来,随着高速光信息处理和集成光 学的迅速发展,对双区激光二极管的研究日 益受到重视,并利用它作某种特殊应用^[1~4]。 例如:利用双二极管激光器产生微微秒级超 短光脉冲,进行光耦合以控制激光输出模式 等。本文报道了 GaAs-Al_{0.3}Ga_{0.7}As DH 共 腔双二极管激光器的实验制备,稳态输出特 性和瞬态输出特性的实验观测。

二、样品制备

图 1 表示 GaAs-Al_{0.3}Ga_{0.7}As DH 共 腔

• 548 •

双二极管激光器的结构。它是在同一衬底上 制作的两个 DH 条形激光器。两个二极管 之间由电隔离槽分开,电隔离槽的深度 h~3 微米,宽度为5 微米,它们是在电学上互为



图1 共腔双二极管激光器结构示意图

收稿日期: 1983年10月12日。

隔离,光学上共用一个谐振腔。 L_1 、 L_2 分别表示两个二极管的腔长,且 $r = \frac{L_2}{L_1} \ll 1$,总 腔长约为500微米,有源层厚度 $d \simeq 0.5$ 微 米,条宽 $b \simeq 10 \sim 15$ 微米。

图 2 是该器件的等效电路图。 R1、R2 分 别表示二极管 D1、D2 的串联电阻, R* 为隔 离电阳。该器件的制备工艺与通常的 GaAs-Alo.3Gao.7As DH 质子轰击条形激光器的制 备工艺相近^[5]。衬底采用掺 Te 或掺 Si 的 N型 GaAs. 晶向严格取<100>面。采用液相 外延工艺在衬底上生长五层结构, 条形限制 是采用浅质子轰击工艺。在将外延片解理成 管芯之前,先制作电隔离槽。它是采用光刻 工艺先夫除蒸发在 P 电极上的 Au-Cr 合金 层, 再将外延片置于 H2SO4 与 H2O2 的混合 溶液中腐蚀 50~60 秒,则得到深度为3微米 左右的电隔离槽。接着将外延片按规定的 r 值进行解理。为避免两个二极管的 P 电极 引出线发生短路,管芯装架采用正装工艺(让 N 电极与热沉焊接),引线采用超声压焊工 艺焊接。



图 2 双二极管激光器的等效电路

采用这种结构和制作工艺,隔离电阻 R* 一般为几百至几千欧姆,而串联电阻 R₁、R₂ 只有几欧姆,故可认为 D₁、D₂ 在电学上得到 很好的隔离。

三、器 件 特 性

双二极管激光器的功率-电流曲线是在 室温下测量的(见图3)。注入到二极管D₁、D₂ 的电流由双路同步脉冲信号发生器提供,脉 冲宽度为500毫微秒,重复频率为2千周。



图 3 稳态功率输出测试原理图

图4是该器件的典型样品的功率-电流 曲线。曲线上的参数为注入电流 I₂ (毫安)。 虚线为双区并联注入的功率-电流曲线,没有 "Kink"出现,可以认为属均匀激射。当注入 电流 I₂ 小于某定值,激光器的外量子效率 7D 随注入电流 I₂ 而增加;当注入电流 I₂ 大 于该定值,激光器的外量子效率 7D 基本保持 不变,且接近于均匀注入条件下之外量子效 率。与此同时,随着注入电流 I₂ 的增加, D₁ 的阈值电流 I₁₁₁随着下降。图 5 表示该器 件之外量子效率与注入电流 I₂ 变化的曲 线。



图5 外量子效率 np 与注入电流 I2 的关系曲线

图 6 是另一类典型样品的功率-电流曲 线。由图 6 可见,在并联均匀注入时,激光输 出在 2.4 毫瓦处出现"Kink"。在非均匀注入 时,"Kink"移向更高功率输出部位;并且随 着注入电流 I₂ 的增加,"Kink"出现之功率 输出部位逐渐下降。



图 6 22* 管的功率-电流曲线 (虚线表示双区并联的功率一电流曲线, 曲线上参数为注入电流 I₂(毫妄))

图7是双二极管激光器的瞬态输出特性 测试原理图。由双脉冲同步发生器产生的两 个同步脉冲信号分别加到两个触发器上,由 触发器产生大电流同步脉冲电流 I₁,I₂ 供给 双二极管。I₁,I₂ 脉冲信号的重复频率由双脉 冲同步信号发生器决定,脉冲幅度由触发器 的直流电源调整,脉冲宽度由改变触发器的 放电电缆长度来控制。脉冲电流 I₁,I₂ 之重 复频率为3千周,上升前沿大约为1毫微秒, 最大电流不低于400毫安;I₁ 之脉冲宽度为 50毫微秒,I₂ 为30毫微秒。由双二极管激 光器发出之激光通过会聚透镜准直以后,由 Si-APD 探测器接收,然后输入取样示波器, 得到光信号波形,并由 *x-y* 函数记录仪记录。

测试是在室温条件下进行的。为了便于 观测,我们选择那些在均匀注入条件下和非 均匀注入条件下的功率-电流曲线都无扭曲 现象的样品。

在均匀注入条件下,光功率输出波形只 呈现张弛振荡。然而在非均匀注入条件下, 当注入电流 I_1 、 I_2 满足某一范围的值时,光 功率输出波形出现大幅度持续振荡,光脉冲 的重复速率为几百至数千兆赫。随着注入电 流继续增大或减少,振荡幅度将逐渐下降,继 而持续振荡消失。图 8 给出了 42[#] 管当 I_1 = 160 毫安、 I_2 =100 毫安时的光功率输出波 形。图 9 给出了 25[#] 管当注入电流 I_1 =195 •550•









图 9 25* 管光输出波形



注入电流密度 j1、j2 的关系 折线 *ABC* 为阈值电流线; ●一测量阈值; ×一大幅度持续振荡; ○一衰减振荡 毫安、 $I_2 = 100$ 毫安时的光功率输出波形。图 10 给出了典型样品的光输出波形和注入电 流密度 j_1, j_2 的关系。

我们制作的 GaAs-Al_{0.3}Ga_{0.7}As DH 共 腔双二极管激光器,由于采用正装装架结构, 热阻较大,未能实现室温下连续工作。如工 艺上解决引出线的短路问题,采用倒装装架 结构(*p* 电极与热沉焊接),实现室温下的连 续工作是完全可能的。

本工作得到王启明副教授的指导,杜宝 助同志以及北京大学郭长志副教授对本工作 提出了很多指导性的意见。在样品制备中得 到了余金中、李静然等同志的大力支持,在此 一并表示感谢。

参考文献

- [1] M. B. Clang, E. Granire; IEEE J. Quant. Electr., 1980, QE-16, 997.
- [2] L. A. Coldern et al.; Appl. Phys. Lett., 1980, 37, 681.
- [3] H. Ito, N. Onodern et al.; Electr. Lett., 1981, 17, 15.
- [4] L. A. Coldern et al.; Appl. Phys. Lett., 1981, 38, 315.
- [5] 中国科学院半导体所 DH 激光组;《激光》,1981,8, No. 10, 16.

(上接第560页)

态相互转化,伴随着声子的吸收和发射发生 了能量的转化。在各类无机玻璃中,离子-离 子或离子-声子耦合强度不同,一般有较广的 展开分布^[4,9]。在氧化物玻璃中,可以通过 Ti⁴⁺-O-Ti³⁺形式的交换耦合^[10],伴随着整 个玻璃网络的振动发生激发的湮灭。在氟磷 酸盐玻璃中,Ti⁴⁺-F-Ti³⁺的耦合较弱,激发 相对而言比较容易定域。通过高阶声子的吸 收和发射,使各个局部格位邻近都有被激活 的 Ti³⁺。所以即使在比吸收谱可见区主峰更 短波长处也能检测到荧光信号的存在。

如上所述,荧光发射属 ${}^{2}B_{1g} \rightarrow {}^{2}B_{2g}$ 跃 迁,电子构型为 $t_{2g} \rightarrow e_{g}^{1}$ 的单电子 跃 迁。这 种跃迁是 Laport 禁戒的,但是自旋允许的。 荧光寿命为 2 微秒,与玻璃中 Cr^{3+} 的单电子 跃迁 $t_{2g}^{2}e_{g}^{1} \rightarrow t_{2g}^{2}$ 荧光发射相比,其跃迁几率 大得多,因此荧光寿命约为后者的十分之一。

参考文献

- [1] 干福熹, 刘慧民; Journal de Physique, 1982, 43, C9-303.
- [2] 刘慧民,陈述春,干福熹;《光学学报》,1982, 2, 393.
- [3] 刘慧民,干福熹;《光学学报》,1982, 2,541.
- [4] 干福熹,刘慧民;《硅酸盐学报》,1983,11,49.
- [5] 干福熹,邓和,刘慧民; J. Non-Cryst. Solids, 1982, 52, 135.
- [6] 干福熹,邓和, 刘慧民; J. Non-Cryst. Solids, 1982, 52, 143.
- [7] B. S. Rawal, R. K. MaoCrone; J. Non-Cryst. Solids, 1978, 28, 337.
- [8] B. M. Loeffier et al.; Proc. 6th Lunar. Soc. Conf., Pergamon, New York (1975), p. 2663.
- [9] 干福熹,刘慧民;(待发表)

The state s

[10] N. F. Mott, E. A. Davis; "Electronics Process in Non-Crystal-Line Solids", Oxford, London (1971).